#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

| (11) Publication numb | er: <b>20</b> ( | 103 | 458 | 326 | Α    |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|
| ( / / ) · wpm+ware    | <u>L</u> U(     |     |     |     | OOLO |

(43) Date of publication of application: 12.12.00

(51) Int. CI

# F01N 3/02

(21) Application number: 11157156

(22) Date of filing: 03.08.99

(71) Applicant:

MITSUBISHI AUTOMOB ENG CO

LTD MITSUBISHI MOTORS

**CORP** 

(72) Inventor.

**IKEDA TATSUYA** 

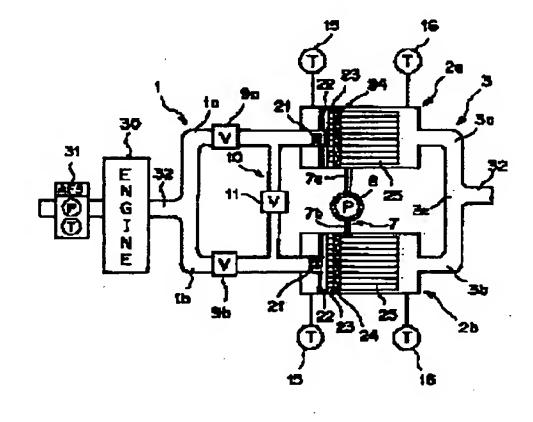
# (54) EXHAUST FINE PARTICLE REMOVING DEVICE

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce cost and to simplify a control system.

SOLUTION: This removing device is constituted by providing filters 25, 25 of two systems in parallel in an exhaust passage of an internal combustion engine and alternately capturing a particulate in an exhaust gas by these filters 25, 25 of two systems combined such that the exhaust gas flow joins at a downstream side of the filters 25, 25 of two systems. The removing device is provided with a differential pressure sensor 8 for detecting the differential pressure at an inlet of the filters 25, 25 of two systems.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-345826 (P2000-345826A)

テーマコート\*(参考)

3G090

(43)公開日 平成12年12月12日(2000.12.12)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> |      | 識別記号  | FI   |      |      |
|---------------------------|------|-------|------|------|------|
| F01N 3/02                 | 3/02 | 3 4 1 | F01N | 3/02 | 341C |
|                           |      |       |      | 341M |      |

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)

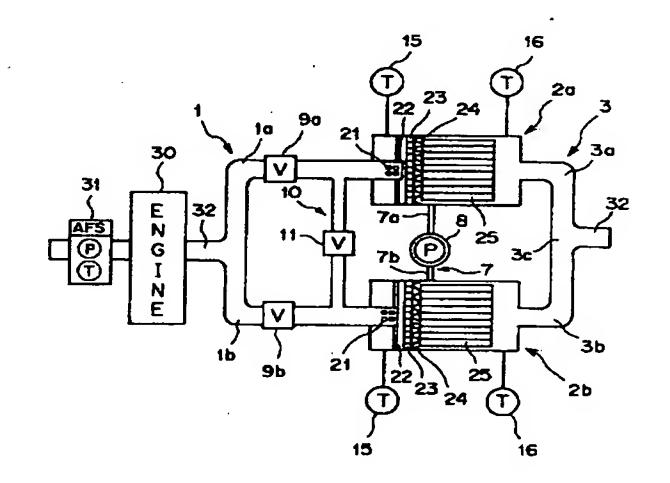
| (21)出願番号 | 特顧平11-157156        | (71) 出願人 000176811                      |
|----------|---------------------|---|
|          |                     | 三菱自動車エンジニアリング株式会社                       |
| (22)出願日  | 平成11年6月3日(1999.6.3) | 東京都大田区下丸子四丁目21番1号                       |
|          |                     | (71) 出願人 000006286                      |
|          |                     | 三菱自動車工業株式会社                             |
|          |                     | 東京都港区芝五丁目33番8号                          |
|          |                     | (72)発明者 池田 達也                           |
|          |                     | 東京都大田区下丸子四丁目21番 1 号 三菱                  |
|          |                     | 自動車エンジニアリング株式会社内                        |
|          |                     | (74)代理人 100092978                       |
|          | •                   | 弁理士 真田 有                                |
|          |                     | Fターム(参考) 3C090 AA04 BA04 CB12 CB18 CB22 |
| •        |                     | CB24 DA04 DA12                          |
|          |                     |   |

# (54) 【発明の名称】 排気微粒子除去装置

# (57)【要約】

【課題】 排気微粒子除去装置において、コストの低減 を図るとともに制御系を簡素化することができるように する。

【解決手段】 内燃機関の排気通路に並列に2系統のフィルタ25,25を設け、これらの2系統のフィルタ25,25により交互に排気ガス中のパティキュレートを捕集するとともに、2系統のフィルタ25,25の下流側で該排気ガスの流れが合流するように構成された排気 微粒子除去装置において、2系統のフィルタ25,25の入口での差圧を検出する差圧センサ8をそなえる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内燃機関の排気通路に並列に2系統のフ ィルタを設け、該2系統のフィルタにより交互に排気ガ ス中のパティキュレートを捕集するとともに、該2系統 のフィルタの下流側で該排気ガスの流れが合流するよう .に構成された排気微粒子除去装置において、

1

該2系統のフィルタの各人口側との間に差圧を検出する 差圧センサをそなえて構成されていることを特徴とす る、排気微粒子除去装置。

【請求項2】 該差圧センサが、該2系統のフィルタの 10 入口を連結するように設けられたパイプ内に設けられ、 該バイブに該排気ガスの圧力変動を減衰させるためのチ ャンバが形成されていることを特徴とする、請求項1記 載の排気微粒子除去装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、内燃機関の排気通 路に2系統のフィルタを設け、この2系統のフィルタに より交互に排気ガス中のバティキュレートを捕集する排 気微粒子除去装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、ディーゼルエンジンから排出さ れる排気ガス中には、カーボンを主成分とするパティキ ュレート(排気微粒子)が含まれている。このため、デ ィーゼルエンジンを搭載した自動車では、排気通路にセ ラミック製の円柱状のディーゼルパティキュレートフィ ルタ(以下、単にフィルタという)を設けて、このフィ ルタで排気ガス中のパティキュレートを捕集して、パテ ィキュレートの大気への排出を抑制している。

が堆積していくと、このパティキュレートによりフィル タ内が目詰まりして通気性が損なわれてしまう。このた め、定期的にフィルタ内のパティキュレートを除去して フィルタの再生を図る必要がある。フィルタを再生する には、フィルタ内のパティキュレートを燃焼させる手法 が一般に良く知られているが、このようなフィルタの再 生時には、フィルタはパティキュレートを捕集すること ができなくなる。そとで、従来より、一対(2つ)のフ ィルタを並行に設け、これらの2つのフィルタにより交 互にパティキュレートを捕集するようにした排気微粒子 40 除去装置が開発されている。

【0004】つまり、いずれか一方のフィルタによりパ ティキュレートの捕集を行ない、このパティキュレート を捕集中のフィルタの再生が必要になったときには、他 方のフィルタによりパティキュレートの捕集を行ないな がら、上記の一方のフィルタの再生を行なうようにし て、これを交互に繰り返すことにより、パティキュレー トの捕集を継続して行なえるようにしているのである。 【0005】なお、フィルタ再生の要否は、フィルタの 排気ガス上流側と下流側との差圧に基づいて判定され

る。これは、フィルタ内にパティキュレートが堆積して いくとフィルタ内の通気性が低下して、フィルタの上流 側と下流側との差圧が上昇するからである。以下、この ような排気微粒子除去装置の構成の一例について図5を 用いて説明すると、排気通路上には、排気ガスの流れ方 向の下流側に向かって2方向に分岐したフロントバイプ 1が設けられており、このプロントパイプ1の途中で分 岐した2つの通路1a, 1bにそれぞれケース2a, 2 bが介装されている。また、各ケース2a,2bの後方 (下流側)には、2つの通路3a,3bを有するテール パイプ3が接続されており、このテールパイプ3を介し て排気ガスは大気に排出される。

【0006】そして、各ケース2a.2b内には、電気 ヒータ(以下、単にヒータという)24と、パティキュ レートを捕集するフィルタ25とが設置されている。ヒ ータ24は、フィルタ25内に堆積したパティキュレー トを燃焼させるための加熱手段であり、図示しない制御 手段(コントローラ)により、その作動が制御されるよ うになっている。

【0007】また、フロントパイプ1の各通路1a,1 b上には、それぞれ開閉弁9a, 9bが設けられてお り、これらの開閉弁9a,9bは、いずれもコントロー ラからの制御信号に基づいて全閉又は全開の何れかの状 態に切り換えられる。つまり、開閉弁9a.9bの作動 状態を制御することにより、通路la,lbが連通状態 又は遮断状態に選択的に切換可能に構成されている。

【0008】そして、上述の開閉弁9a、9bの開閉状

態を制御することにより、並列に設けた2つのフィルタ 25.25でパティキュレートの捕集を交互に行なっ 【0003】ところで、フィルタ内にパティキュレート 30 て、パティキュレートの捕集を継続して行なうのであ る。つまり、ケース2a内のフィルタ25によりパティ キュレートを捕集するときは、開閉弁9aを全開且つ開 閉弁9bを全閉にして、排気ガスの全量をケース2aに 流すようにし、一方、ケース2 b内のフィルタ25によ りパティキュレートを捕集するときは、開閉弁9aを全 閉且つ開閉弁9bを全開にして、排気ガスの全量をケー ス2bに流すようにするのである。

> 【0009】また、上記の通路laと通路lbとの間に は、通路10が設けられている。ことで、この通路10 の一端は、開閉弁9 a とケース2 a との間に接続され、 また、その他端は、開閉弁9bとケース2bとの間に接 続されている。また、この通路10には、制御弁11が 介装されている。との制御弁11は、ととではコントロ ーラからの制御信号に基づいてその開度が調整可能な制 御弁として構成されている。

【0010】また、各ケース2a,2b内のフィルタ2 5,25の排気ガス上流側にはフィルタ入口圧力センサ 5が、排気ガス下流側にはフィルタ出口圧力センサ<br />
6 が、それぞれ付設されている。そして、これらの圧力セ 50 ンサ5, 6からの検出情報は図示しないコントローラに 43

出力されるようになっており、コントローラでは、圧力 センサ5,6からの検出情報に基づきフィルタ25の再 生の要否を判定するようになっている。

【0011】つまり、圧力センサ5,6からの検出情報 によりフィルタ25の出入口での差圧△P。が演算され て、この差圧AP。が所定値以上になった場合には、バ ティキュレートが所定量よりも堆積したためにフィルタ 25の通気性が低下したものと判定され、フィルタ25 の再生が行なわれるのである。なお、このような圧力セ ンサ5、6を、1つの差圧センサに置き換えてもよい。 【0012】さらに、各ケース2a,2bには、フィル タ25の排気ガス上流側に、フィルタ入口温度センサ1 5が、排気ガス下流側にフィルタ出口温度センサ16が 付設されており、フィルタ入口圧力センサ5に検出され た圧力情報は、フィルタ入口温度センサ15により検出 された温度情報により補正され、フィルタ出口圧力セン サ6により検出された圧力情報は、フィルタ出口温度セ ンサ16により検出された温度情報により補正される。 【0013】そして、各ケース2a,2b内のフィルタ 25のうち、一方のフィルタ(例えばケース2a内のフ 20 ィルタ)25にパティキュレートが堆積した場合には、 以下のように、フィルタ25の再生が行なわれるととも に、他方のフィルタ(例えばケース2b内のフィルタ) 25により、パティキュレートの捕集が行なわれるよう になっている。

【0014】まず、開閉弁9aを全閉状態にするとともに開閉弁9bを全開状態にして、ケース2a内への排気ガスの流入を遮断する。これにより、フロントパイプ1内の排気ガスは、全量通路1b側に流入し、排気ガス内に含まれるパティキュレートは他方のフィルタ(例えばケース2b内のフィルタ)25で捕集されるようになる。そして、この状態でケース2a内のフィルタ25をヒータ24により加熱して、パティキュレートの主成分であるカーボンを燃焼させるのである。

【0015】また、このときには、制御弁11が所定開度となるように制御されて、パティキュレートの燃焼に必要な酸素が通路10側からケース2a内に供給される。一方、ケース2b内のフィルタ25にパティキュレートが堆積した場合には、上述とは逆に、開閉弁9aを全開状態にするとともに開閉弁9bを全閉状態にして、ケース2a内のフィルタ25により排気ガス中のパティキュレートを捕集するとともに、ケース2b内のヒータ24により加熱してケース2b内のフィルタ25に堆積したパティキュレートを燃焼させるのである。

【0016】なお、図5中の符号21は排気ガス分散用パイプ、符号22はバッフル、符号23は反射板、符号30はエンジン(内燃機関)、符号31はエアフローセンサ(AFS)である。排気ガス分散用パイプ21の排気ガス下流側の端部は閉塞され、また、その周面には、複数の小径孔が全体にわたって設けられている。したが 50

って、排気管より直進して流れてくる排気ガスは、排気ガス分散用パイプ21の周面の孔から排気ガス分散用パイプ21の径方向に向かって流出し、これにより、排気ガスを外側(ケース2a,2bの内周面側)に分散させて、排気ガスの流れがフィルタ25の中心軸線付近に集中するのを防止している。そして、分散した排気ガスは、バップル22によって整流されてフィルタ25に流入する。また、反射板23は、ヒータ24からの放射熱をフィルタ25側に反射させて、フィルタ25内に堆積したパティキュレートを効率よく燃焼させるためのものである。

#### [0017]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の排気微粒子除去装置では、並列に設けた各フィルタの出入口差圧を検出するためには、各フィルタの入口及び出口にそれぞれ圧力センサを設置するので計4つの圧力センサが必要となる。又、各フィルタの入口と出口とに圧力センサを設ける代わりに差圧センサを設けた場合でも、合計2つの差圧センサが必要となって、センサにかかるコストが比較的高くなってしまうという課題がある。また、センサ数に応じて、コントローラの入力ボート数や演算処理が増加するので、制御系が複雑になるという課題もある。

【0018】また、エンジンから排出される排気ガスの圧力は、各排気行程の初期に直前の膨張行程の影響を受けて上昇するため、周期的に変動する。したがって、図6(a)に示すように、フィルタ入口の排気ガス圧力P1にも、エンジンのサイクルに応じて周期的な変動(脈動)が生じる。これに対し、フィルタ出口では、排気ガスはヒータやフィルタ等を通過するので、このような脈動が減衰して、フィルタ出口の排気ガス圧力P2は、図示するように変動のないものとなる。このため、図6(b)に示すように、排気ガス圧力P1、P2の差である差圧ΔP。(ΔP。=P1-P2)は、脈動を有するものとなって、差圧ΔP。に基づいて行なわれるフィルタの切換制御が不安定になってしまうという課題もある。

【0019】ところで、特開平1-92510号公報には、排気管の途中に直列に配設されたフィルタトラップ 及び消音器をそなえたフィルタトラップシステムにおいて、1つの差圧センサにより、フィルタトラップの前後の差圧と、消音器の前後の差圧とを検出できるようにした技術が開示されている。この技術では、差圧センサは、2つのパイロット管を有しており、一方のパイロット管はフィルタトラップと消音器との間の排気管に接続されている。また、他方のパイロット管は、方向切換弁を介して、2つの分岐管に切換可能に接続されており、一方の分岐管は、フィルタトラップ上流側の排気管に接続 たれ、他方の分岐管は、消音器下流側の排気管に接続 たれている。これにより、方向切換弁を切り換えること により、1つの差圧センサによりフィルタトラップの前 後の差圧と消音器の前後の差圧とを検出することができ る。

【0020】この技術は、上述のような並列に配設され た2つのフィルタをそなえて構成される排気微粒子除去 装置(図5参照)にも適用可能であり、例えば、差圧セ ンサが有する2つのパイロット管のうち、一方のパイロ ット管を、各フィルタの排気ガス下流側の排気ガス合流 部に接続し、他方のパイロット管を方向切換弁及び2つ の分岐管を介して、各フィルタの排気ガス上流側に接続 10 すればよい。

【0021】これにより、1つの差圧センサによって2 つのフィルタの出入口差圧を計測することができるの・ で、差圧センサが削減されて、差圧センサにかかるコス トの低減及び制御系の簡素化を行なうことができる。し かしながら、切換弁の設置、切換弁回りの配管のシール 性の確保及び切換弁の制御が新たに必要となるため、排 気微粒子除去装置全体としては、コストの低減及び制御 系の簡素化を図ることができない。

脈動に起因してフィルタの切換制御が不安定になってし まうという課題を解決するものでもない。本発明は、こ のような課題に鑑み創案されたもので、コストの低減を 図るとともに制御系を簡素化することができるようにし た、排気微粒子除去装置を提供することを目的とする。 [0023]

【課題を解決するための手段】このため、請求項1記載 の排気微粒子除去装置では、内燃機関の排気通路に設け られた2系統のフィルタにより交互に排気ガス中のパテ ィキュレートの捕集が行なわれ、一方のフィルタが、排 気ガスが流入して排気ガス中のパティキュレートを捕集 する使用状態のときには、他方のフィルタは、排気ガス の流入しない待機状態となる。

【0024】各フィルタは出口側で接続されているの で、使用状態のフィルタ出口での排気ガス圧力と、待機 状態のフィルタ出口での排気ガス圧力は当然等しくな り、又、待機状態のフィルタにおいては、出口側の圧力 と、入口側の圧力とは等しくなる。したがって、2系統 のフィルタの各入口側との間にそなえられた差圧センサ により差圧を検出することにより、使用状態のフィルター の出入口の差圧が検出される。

【0025】請求項2記載の排気微粒子除去装置では、 請求項1記載の排気微粒子除去装置において、2系統の フィルタの入口を連結するように設けられたパイプ内に 流入した排気ガスの圧力変動が、パイプに形成されたチ ャンパにより減衰して、これにより、内燃機関のサイク ルに起因した排気ガスの圧力変動の影響を受けることな く、パイプ内に設けられた差圧センサによりフィルタの 出入口の差圧が検出される。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、図面により、本発明の実施 の形態について説明する。まず、本発明の第1実施形態 としての排気微粒子除去装置について図1~図3を参照 しながら説明する。なお、以下では、従来技術として説 明した部材と同一の部材については、同一の符号を付し その説明を一部省略する。

【0027】本発明の第1実施形態としての排気微粒子 除去装置は、図1に示すように、並行に設けられた一対 (2つ)のフィルタ25,25をそなえて構成され、各 フィルタ25,25の排気ガス出入口差圧(以下、単に フィルタ差圧という)に基づいて、フィルタ25.25 の切換制御を行なうことにより、2つのフィルタ25、 25で交互にバティキュレートを捕集するようになって いる。そして、1つの差圧センサ8で、各フィルタ差圧 を検出できるようにするとともに、各フィルタ差圧の脈 動に起因してフィルタ25.25の切換制御が不安定と なってしまうことを防止できるようになっている。

【0028】具体的には、本実施形態の排気微粒子除去 装置は、図1に示すように、内燃機関としてのディーゼ 【0022】また、フィルタ入口の排気ガス圧力P1の 20 ルエンジン(以下、単にエンジンという)30の排気通 路32の途中に介装され、上流側からフロントパイプ 1,ケース2a,2b及びテールパイプ3をそなえて構 成されている。このうちフロントパイプ1は、排気ガス 流れ方向下流側に向かって2つの通路1a.1bに分岐 し、各通路la、lbの下流端はケース2a、2bにそ れぞれ接続されている。また、各ケース2a, 2bの下 流側には、2つの通路3a、3bを有するテールパイプ 3が接続されている。

> 【0029】また、フロントパイプ1の各通路1a, 1 b上には、開閉弁9a, 9bが設けられている。また、 通路laと通路lbとの間には、通路l0が設けられ、 この通路10には制御弁11が介装されている。さて、 ケース2a, 2bの内部は、略同様に構成されており、 排気ガス分散用パイプ21.バッフル22.反射板2 3,ヒータ24及びフィルタ25が、排気ガス上流側か らこの順に並べて設けられている。

> 【0030】さらに、各フィルタ25、25の排気ガス 入口近傍(入口もしくは入口に近い部分,入口側)の相 互間には通路(パイプ)7が設けられ、この通路7に は、図示しないコントローラに接続された差圧センサ8 が介装されている。そして、上述したように1つの差圧 センサ8により各ケース2a, 2b内のフィルタ差圧△ P。をそれぞれ検出することができるようになってい る。

【0031】ここで、1つの差圧センサ8により、各ケ ース2a, 2bのフィルタ差圧AP。を検出できる理由 を説明する。本発明の排気微粒子除去装置は、上述した ように各ケース2a、2b内のフィルタ25、25によ り交互にパティキュレートを捕集するものであり、例え 50 ば、ケース2b内のフィルタ25により排気ガス中のパ (5)

ティキュレートを捕集するときには、ケース2a側の開 閉弁9aは全閉、ケース2b側の開閉弁9bは全開、制 御弁11は全閉に制御されるようになっている。 これに より、排気ガスの全量がケース2bに流入してケース2 b内のフィルタ25により、パティキュレートの捕集が 行なわれるようになっている。

【10101312】このとき、通路11aは開閉弁9aにより遮 断され、通路10は制御弁11により遮断された状態な ので、排気微粒子除去装置の排気ガス系統は、図2 (a) に示す状態と等価なものとなり、ケース2 b内の 10 フィルタ差圧AP。(通路7bでの排気ガス圧力と、通 路3bでの排気ガス圧力との差)が検出できるようにな っている。つまり、各ケース2a,2bの下流側は、テ ールパイプ3で接続されているので、図2(a)に示す ような状態であれば、ケース2 bの出口側(通路3 b 側)圧力とケース2aの出口側(通路3a側)圧力とは 等しくなる。また、ケース2aに着目すると、このとき ケース2 a は、フロントパイプ 1 の通路 1 a と遮断され ているので、ケース2a内では入口側(通路7a側)圧 力と出口側(通路3a側)圧力とは等しくなる。従っ て、ケース2aの入口側(通路7a側)圧力を検出する ことで、ケース2aの出口側(通路3a側)圧力、ひい てはケース2bの出口側(通路3b側)圧力を知ること ができるのである。従って、差圧センサ8により通路7 a,7bの差圧を検出することで、ケース2b内のフィ ルタ差圧AP。(通路7bでの排気ガス圧力と、通路3 bでの排気ガス圧力との差)が検出できるのである。 【0033】なお、ケース2bからの排気ガスは、テー

 $\Delta P_{AV} = (\Delta P_n + k \times \Delta P_{n-2}) / (k+1)$ 

【0036】つまり、平均差圧ΔP,、は、前フィルタ 差圧ΔP<sub>α-1</sub> と現フィルタ差圧ΔP<sub>α</sub>との中間値となる ので、図3中に一点鎖線で示すように、実際のフィルタ 差圧ΔΡ。よりも変動が抑制され、このような平均差圧 ΔP<sub>A</sub>、に基づいて、ヒータ24, 開閉弁9a, 9b及 び制御弁11の作動を制御することにより、各ケース2 a,2b内のフィルタ25の切り換えを安定して行なえ るようにしているのである。

ルパイプ3の合流部3cから排気通路32を通って流出

し、通路3a、ケース2a及び通路7aにより形成され\*30

【0037】なお、上式(1)のkは、指数平均(平均 40 k 差圧ΔP,、)を演算するにあたり、前フィルタ差圧Δ Ρ - 1 と現フィルタ差圧Δ P 。との重みを決定する係数。 であって、平均差圧 APAV は、係数kが大きくなるほ ど、前フィルタ差圧△P<sub>1-1</sub>の影響を強く受け、逆に、 係数kが小さくなるほど、現フィルタ差圧AP。の影響 を強く受けることになる。

【0038】また、各ケース2a,2bのフィルタ25 の排気ガス出入口には、フィルタ入口温度センサ15及 びフィルタ出口温度センサ16がそれぞれ付設されてお \* る排気ガス流路は、排気ガス流れの殆どない状態とな り、かかる排気ガス流路により圧力損失が生じることは ない。但し、この排気ガス流路の圧力損失が無視できな い場合には、コントローラにより、この圧力損失分を補 正するようにすれば良い。

【0034】一方、ケース2a内のフィルタ25により 排気ガス中のパティキュレートを捕集するときには、開 閉弁9aは全開、開閉弁9bは全閉、制御弁11は全閉 とされるようになっている。したがって、通路1bは開 閉弁9bにより遮断され、通路10は制御弁11により 遮断された状態なので、このときの排気微粒子除去装置 の排気ガス系統は、図2(b)に示す状態と等価なもの となって、差圧センサ8により、ケース2a内のフィル タ差圧△P。が検出できるようになっている。

【0035】このように、本発明の排気微粒子除去装置 では、1つの差圧センサ8を用いて2つのケース2a, 2 b内におけるフィルタ差圧 AP。を、それぞれ検出す ることができるようになっているのである。さて、従来 技術の課題として既に述べたように、フィルタ差圧AP 。には、図3中に実線で示すようにエンジン30のサイ クルに応じて脈動が生じるため、本実施形態の排気微粒 子除去装置では、コントローラにおいて、以下の式 (1)により、前回の制御周期において検出されたフィ ルタ差圧(以下、前フィルタ差圧という)Δ P。-, と、 今回の制御周期において検出されたフィルタ差圧(以 下、現フィルタ差圧という)AP。との指数平均(平均) 差圧) ΔΡ Αν を演算し、このΔΡ Αν に基づいて、フィ ルタ25,25の切換制御が行なわれるようになってい

#### $\cdot \cdot \cdot (1)$

る。

ーラに出力されるようになっている。そして、コントロ ーラでは、この温度センサ15,16からの検出情報に 基づいて、フィルタの入口ガス温度及び出口ガス温度の 平均により、平均差圧 APAV を温度補正するようにな っている。

【0039】本発明の第1実施形態としての排気微粒子 除去装置は、上述のように構成されているので、ケース 2a, 2bによるパティキュレートの捕集の切り換え は、以下のように行なわれる。例えば、ケース2b内の フィルタ25により、排気ガス中のパティキュレートの 捕集が行なわれているときは、開閉弁9aは全閉、開閉 弁9bは全開、制御弁11は全閉とされ、この状態で は、上述したように、ケース2b内のフィルタ差圧AP 。が、差圧センサ8により検出される〔図2(a)参 照)。

【0040】そして、コントローラでは、上式(1)に より、このフィルタ差圧△P。と前フィルタ差圧△P 。- 1 との指数平均(平均差圧) APAV が演算され、C り、これらの温度センサ15,16の検出値はコントロ 50 の平均差圧 Δ Р 🗸 が所定値以上になった場合には、ケ

ース2b内のフィルタ25にパティキュレートが堆積し たと判定されて、開閉弁9a、9bが切り換えられ、ケ ース2a内のフィルタ25によりパティキュレートの捕 集が行なわれるとともに、ケース2b内のフィルタ25 の再生が開始される。

【0041】具体的には、コントローラにより、ケース 2 b内のヒータ24は作動状態、開閉弁9 a は全開、開 閉弁9 b は全閉、制御弁11は所定開度となるように制 御される。これにより、排気ガスのほとんどは、通路1 aからケース2a内のフィルタ25に流入して、このフ 10 ィルタ25でパティキュレートが捕集され、一方、ケー ス2b内のフィルタ25は、ヒータ24により加熱さ れ、フィルタ25内に堆積したパティキュレートが燃焼 する。このとき燃焼に必要な酸素は、制御弁11を介し てケース2b内に供給される。

【0042】一方、ケース2a内のフィルタ25によ り、排気ガス中のパティキュレートが捕集されていると きは、開閉弁9aは全開、開閉弁9bは全閉、制御弁1 1は全閉とされ、この状態では、上述したように、ケー 出される〔図2(b)参照〕。そして、このフィルタ差 圧AP。が所定値以上になったときには、ケース2a内 のヒータ24は作動状態、開閉弁9aは全閉、開閉弁9 bは全開、制御弁11は所定開度となるように制御され る。そして、これ以外は上述と同様にしてフィルタ25 の再生が行なわれる。

【0043】このように、ケース2a,2b内のフィル タ25の各差圧ΔP。を、従来の排気微粒子除去装置で は、上述したように4つの圧力センサまたは2つの差圧 センサにより検出しているのに対し、本実施形態の排気 微粒子除去装置によれば、1つの差圧センサ8により検 出することができる。したがって、センサが削減される ので、コストが低減されるとともに制御系が簡素化され るという利点がある。

【0044】また、前フィルタ差圧△ P - - 」と現フィル タ差圧ΔP。との中間値となる平均差圧ΔP<sub>A</sub>、に基づ いてフィルタ25の再生の要否が判定されるので、エン ジン30のサイクルに応じて発生する実際のフィルタ差 圧AP。の脈動に影響されずに、安定してフィルタ25 の切換制御を行なうことができるという利点がある。ま 40 た、例えば、従来技術の排気微粒子除去装置(図5参 照)において、各フィルタのそれぞれに差圧センサを設 けて各フィルタの差圧△P。を検出する場合は、各差圧 センサには、それぞれセンサ固有値(それぞれのセンサ が有する検出値のばらつき)があるため、このセンサ固 有値差が、フィルタ差圧△P。に基づくフィルタの切換 制御に影響する。これに対し、本実施形態の排気微粒子 除去装置によれば、1つの差圧センサにより各フィルタ の差圧AP。を検出するので、当然ながら、従来技術の ようにセンサ固有値に差異がないため、フィルタ差圧△ 50

P。に基づいて、フィルタの切換制御を安定して行なえ るという利点がある。

10

【0045】なお、本実施形態では、平均差圧△PAV を、前フィルタ差圧△P。-、と現フィルタ差圧△P。と の指数平均として算出しているが、平均差圧AP Av は、実際のフィルタ差圧 ΔP。よりも変動の抑制さ れたものであれば良く、指数平均の代わりに、例えば、 以下の(2)式に示すような移動平均により平均差圧△ Pwを算出してもよい。なお、(2)式中のAP。。は 所定回数i前の制御周期において検出されたフィルタ差 圧を示す。

[0046] 【式2】

$$\Delta P_{AV} = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{L} \Delta P_{n-i} \qquad \dots \qquad (2)$$

【0047】次に、本発明の第2実施形態としての排気 微粒子除去装置について図4を参照しながら説明する。 なお、以下では、従来技術及び第1実施形態として説明 ス2aのフィルタ差圧AP。が、差圧センサ8により検 20 した部材と同一の部材については、同一の符号を付しそ の説明を省略する。本実施形態の排気微粒子除去装置 は、図4に示すように、第1実施形態の排気微粒子除去 装置について、差圧センサ8の両側にチャンバ35a. 35bを設けた構造のものである。

> 【0048】つまり、第1実施形態では、実際のフィル タ差圧ΔPn よりも変動を抑制した平均差圧ΔP,、 に 基づいてフィルタ25、25の切換制御を行なうことに より、エンジン30のサイクルに応じて発生するフィル タ差圧△P。の脈動(排気ガス圧力の脈動)に影響を受 30 けることなく、安定してフィルタ25,25の切換制御 を行なえるようにしているのに対し、本実施形態の排気 微粒子除去装置では、差圧センサ8の両側にチャンバ3 5a, 35bを設けることにより、排気ガス圧力の脈動 を減衰して、安定してフィルタ25,25の切換制御を 行なえるようにしている。

【0049】前述したように、フィルタ差圧△P。の脈 動は、即ち、各フィルタ25の入口圧力P1の脈動であ る。本実施形態の排気微粒子除去装置は、第1実施形態 と同様に、フィルタ2bの差圧を検出するときには差圧 センサ8の通路7b側がフィルタ25の入口圧力P1の 検出側となり〔図2(a)参照〕、一方、フィルタ2a の差圧を検出するときには差圧センサ8の通路7a側が フィルタ25の入口圧力P1の検出側となる〔図2 (b)参照)。

【0050】つまり、差圧センサ8の両側が、フィルタ 25の入口圧力P1の検出側となりうるため、差圧セン サ8の両側にチャンバ35a, 35bを設けて、入口圧 カP 1 の脈動を減衰するようにしているのである。ま た、本実施形態では、チャンパ35a,35bによりフ ィルタ差圧AP。の脈動が直接に抑制されるため、第1

実施形態のように平均差圧△P、、に基づいて制御を行 なう必要はない。従って、フィルタ差圧AP。に基づい て、コントローラにより、ヒータ24、開閉弁9a、9 b及び制御弁11の作動が制御されるようになってい る。

【0051】本発明の第2実施形態としての排気微粒子 除去装置は、上述のように構成されているので、フィル タ差圧△P。に基づいて、フィルタ差圧△P。が所定値 以上になった場合、捕集中のフィルタ25にパティキュ レートが堆積したとして、第1実施形態と同様にフィル 10 タ25.25の切換制御が行なわれる。したがって、平 均差圧△P√を演算する必要がなくなり、より簡素な制 御システムで第1実施形態と同様の効果が得られるとい う利点がある。

【0052】なお、本発明の排気微粒子除去装置は、上 述の実施形態のものに限定されず、本発明の趣旨を逸脱 しない範囲で種々の変形が可能である。例えば、各実施 形態では、配管7に1つの差圧センサ8を介装している が、各配管7a,7bにそれぞれ圧力センサを設けて、 構成してもよい。このときには、2つの圧力センサから の圧力情報により、コントローラが差圧を演算するよう に構成する。との場合でも、従来の排気微粒子除去装置 においては、圧力センサにより各ケース2a, 2b内の フィルタ差圧AP。を検出するには4つの圧力センサが 必要となるので、従来に較べ、本発明の排気微粒子除去 装置は圧力センサの数量を半減できる。

#### [0053]

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1記載の本 発明の排気微粒子除去装置では、内燃機関の排気通路に 設けられた2系統のフィルタにより交互に排気ガス中の パティキュレートの捕集が行なわれ、一方のフィルタ が、パティキュレートを捕集する使用状態のときには、 他方のフィルタは、排気ガスの流入しない待機状態とな る。各フィルタは出口側で接続されているので、使用状 態のフィルタ出口での排気ガス圧力と、待機状態のフィ ルタ出口での排気ガス圧力は当然等しくなり、又、待機 状態のフィルタにおいては、出口側の圧力と、入口側の 圧力とは等しくなる。したがって、2系統のフィルタの 各入口側との間に介装された差圧センサにより差圧を検 40 出することにより、使用状態のフィルタの出入口の差圧 が検出される。

【0054】つまり、何れのフィルタにより排気ガス中 のパティキュレートの捕集が行なわれている場合にも、 常に使用状態のフィルタの出入口差圧が検出されるの で、2系統のフィルタの出入口差圧を、1つの差圧セン サにより検出できるのである。従って、例えば、2つの 差圧センサにより2系統のフィルタの出入口の差圧を検 出していた従来技術に対して、差圧センサが半数となっ

て、コストの低減を図るとともに制御系を簡素化するこ とができるという利点がある。

【0055】また、各フィルタのそれぞれに差圧センサ を設けて各フィルタの出入口差圧を検出するような従来 技術では、各差圧センサには、それぞれセンサ固有値が あるため、このセンサ固有値差が、フィルタの出入口差 圧に基づくフィルタの切換制御に影響する。これに対 し、請求項1記載の本発明の排気微粒子除去装置によれ ば、1つの差圧センサにより各フィルタの出入口差圧を 検出するので、当然ながらセンサ固有値に差異がないた め、フィルタの切換制御を安定して行なえるという利点 がある。

【0056】請求項2記載の本発明の排気微粒子除去装 置では、2系統のフィルタの入口を連結するように設け られたパイプ内に流入した排気ガスの圧力変動が、パイ プに形成されたチャンバにより減衰し、これにより、内 燃機関のサイクルに起因した排気ガスの圧力変動の影響 を受けることなく、パイプ内に設けられた差圧センサに より各フィルタの出入口の差圧が検出されるので、この、 これらの2つの圧力センサによって1つの差圧センサを 20 差圧に基づいて2系統のフィルタの切り換えを安定して 行なうことができるという利点がある。

#### ・【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態としての排気微粒子除去 装置の構成を示す模式図である。

【図2】本発明の第1実施形態としての排気微粒子除去 装置の各フィルタの出入口差圧の検出方法を説明するた めの模式図であって、(a)は下方のフィルタの出入口 差圧の検出状態を示す図、(b)は上方のフィルタの出 入口差圧の検出状態を示す図である。

【図3】本発明の第1実施形態としての排気微粒子除去 装置におけるフィルタ出入口の平均差圧の挙動の一例を 示す模式図である。

【図4】本発明の第2実施形態としての排気微粒子除去 装置の構成を示す模式図である。

【図5】従来の排気微粒子除去装置の構成を示す模式図 である。

【図6】従来の排気微粒子除去装置のフィルタの出入口 圧力及び差圧の挙動を示す模式図であって、(a)はフ ィルタの入口圧力及び出口圧力を示す図、(b)はフィ ルタの出入口差圧を示す図である。

### 【符号の説明】

7 通路(パイプ)

8 差圧センサ

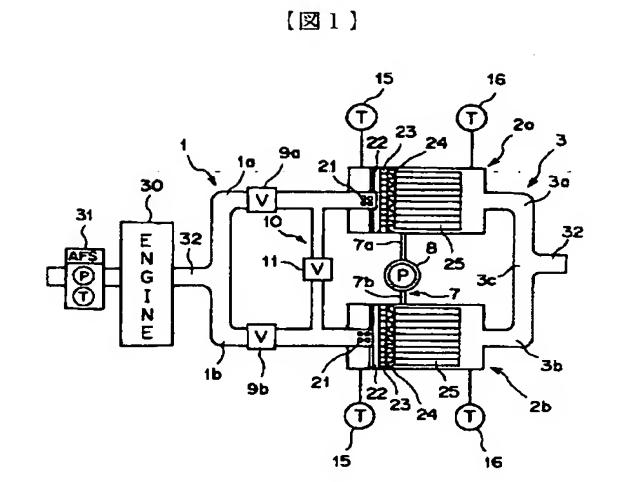
25 フィルタ

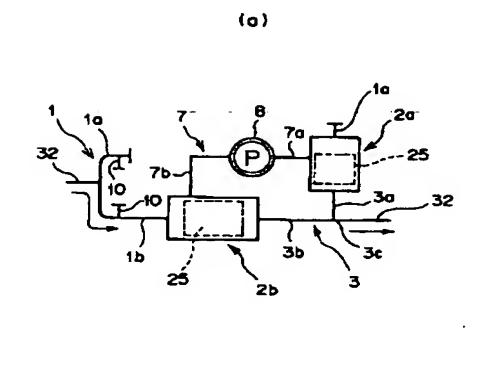
30 エンジン(内燃機関)

32 排気通路

35a, 35b チャンパ

ΔΡ。フィルタ差圧





【図2】

